

PATENT ABSTRACT OF JAPAN

Japanese Patent Laid-Open Application No.S57-161767
Opened: October 5, 1982
Application No.S56-46961
Date of Filing: March 30, 1981

HEAT ROLLER FIXING DEVICE

Abstract:

PURPOSE:

To control the temperatur of the circumferential surface of a heat roller by a heat-sensitive element at a center part by positioning a bimetal on the one-end circumferential surface of the heat roller, and then controlling the fixation allowable temperature of the circumferential surface of the heat roller through the sensing of the bimetal.

CONSTITUTION:

At one lengthwise end part G or E of the heat roller 1 of a fixing roller consisting of the heat roller 1 and a press-contacting roller 2, a two-position detecting element 4 composed of a bimetal is positioned extending over the circumferential surface to operate at the upper-limit and lower-limit temperatures of the fixation allowable temperature of the circumferential surface of the heat roller 1, and each detection signal of this two-position detecting element 4 is used as a warning signal for a warning display part. The two- position detecting element 4 has, for example, a bimetal contact piece X and fixed contact pieces Y and Z, and a heat-sensitive element 3 provided at the lengthwise center part F of the heat roller 1 senses fixation set temperature, so that the tip part of the bimetal contact piece X touches the fixed contact piece Y or Z.

① 特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭57—161767

⑤ Int. Cl.³

識別記号

室内整理番号

④公開 昭和57年(1982)10月5日

G 03 G 15/20

102

7381-2H

発明の数 1

審查請求	未請求
<p>1. 發明之技術領域</p> <p>2. 發明之背景技術</p> <p>3. 發明之技術方案</p> <p>4. 發明之有益效果</p> <p>5. 發明之實施例</p> <p>6. 發明之結論</p>	<p>1. 發明之技術領域</p> <p>2. 發明之背景技術</p> <p>3. 發明之技術方案</p> <p>4. 發明之有益效果</p> <p>5. 發明之實施例</p> <p>6. 發明之結論</p>

(全 3 頁)

⑤加熱ローラ定着装置

②特 領 昭56-46961

出 願 昭56(1981)3月30日

⑦発 明 者 伊藤 丘

八王子市石川町2970番地小西六

写真工業株式会社内

⑦出 願 人 小西写真工業株式会社

東京都新宿区西新宿1丁目26番
2号

④代理人 弁理士 太田晃弘

明 弘治 丁丑 年 丁丑 年 丁丑 年

1. 常用名称

加島口一→定府義田

2 5 7 9 10 11 12

(11) 加硫ヒートを入置し、且つ四度四割される加硫ローラと、この加硫ローラに依り育れる成ロローラとの間を距離を通過させ、この距離に加硫ローラ四度の端下距離を加硫端をさせる加硫ローラ定端四割に在りて、前記加硫ローラの一出口口に成り成口に成口し、成りするパイナドルを白え、前記パイナドルの成口の成口を白出し各給出成等て成り成口する加硫ローラ定端四割。

3. 發明之內容及說明

本題明紙、例文或口字等ハ抄写の符号用いられ
る加口口一ヲ形定符號口ニ因する。

馬廻りのように、船屋ロータ、船屋切替口は、行船時に船屋を渡る船屋ロータを内庫した船屋ロータと、この船屋ロータに接合される床屋ロータとの間で船屋を渡る船屋ロータを、この船屋ロータ

加硫ローラ門西の端でトナー等よりなる西側を加硫室口をせる。又、加硫ローラ門西の長手方向中央部には加硫ローラ門西の口部に厚板する厚板が位置され、この厚板が子によって加硫ローラの口が閉められる。

ととるで、白田加島ローラ周間の口度係、第1圖に示した口度分布にある。第1圖は加島ローラ周間の口度係の口度分布を示した白田図であつて、第1圖のA~Bは假想した加島ローラ周間のA~B値口を示し、T₀は定力設定口度、T₁は定力降下下限口度、T₂は定力降下上限口度をそれぞれ示しており、矢印で示した折口は口度係に与ける加島ローラ周間の口度分布を示している。この折口から明らかなように、加島ローラ周間の口度係は山形の分布形状にあり、加島ローラ両端口の口度は定力降下区間の範囲内にあるけれども、中央部は比しての受暑よりの放熱等もあり、低口度となる。したがつて、昇降時、昇降の起降時に与る加島係、降降は自身も低口であるため、加島ローラ周間の口度係は山形にあり、降降として

特開第57-161767(2)

加線ローラ両面は全体的に盛面となり、加線ローラ両面の口底は第1図の折面にて示す分布状口底となる。この折面から明らかなように、加線ローラ両面部の口底は定形降下線口底T:以下となり、口底のロビー領域に定形アンダーが生じる。また、逆像転写した場合に、配線部の両面部は中央部に比べて口底が少なく、しかも感受部等の加線も進むので、加線ローラ両面部の口底が上昇し、加線ローラ両面の口底は第1図の折面にて示すような谷形の分布状口底となる。この折面から明らかなように、加線ローラ両面部の口底は定形降下線T:を逸脱し、配線部のトナーが漏洩され始めて露露が起み、いわゆるオフセット現象を起してしまふ。

このために、従来では、例えば特公第55-4974号公報に示されたように、発熱ヒータを、加線ローラの両面部を加線するヒータと、加線ローラの中央部を加線するヒータとを分け、これらのヒータに対応され互に設定温度の等しい口底粒子を加線ローラ両面の中央部と一両部に位置させ、

を提供するものである。

以下、本発明の実施例を図2図、第3図、第4図について説明する。

第1図は本発明の加線ローラ定形口底形成の原理図である。加線ローラ1には加線ローラ1の長手方向に設置された口底曲を発熱ヒータHが内蔵され、Hは加線ローラ1は圧力ローラ2が接触され、Hはこれらの加線ローラ1と圧力ローラ2との間に定形口底が形成され、この定形口底に加線ローラ1両面の口底が加線形成される。また、第2図は第1図に示すように、加線ローラ1の長手方向中央部には口底粒子3が加線ローラ1両面に付着状態で位置され、Hは口底粒子3が加線ローラ1両面の定形口底口底を形成することによつて、発熱ヒータHの口底曲が図示を省略した図面を介して形成される。

一方、本発明によれば、加線ローラ1の長手方向一端部(または他端)には、第3図示のバイメタル片Xを口底、このバイメタル片Xの両端部は、加線ローラ1両面の口底が定形降下線以下のと固定部片Yに形成され、また加線ローラ1両面の口底が定形降下線を上昇したと固定部片Zに形成される。これらのバイメタル片X、固定部片Y、Zは前述した動作図、口底形成図に口底的に接続され、バイメタル片Xが、第3図の状口、即ち固定部片Y、Zのいずれとも接触したとき動作図に、例えば「CO

これらの口底粒子によつて加線ローラ両面の中央部と両面部を個別に口底形成することが行なわれているが、この対比では、加線ローラ両面部の口底は定形口底である。立て直められ、加線ローラ両面の口底が長手方向に均一にされるけれども、口底した定形口底の加線ローラ両面部の口底上昇は口底の形成、感受部等の口底に起因するため、加線ローラ両面部の口底は前述折面よりも口底に立上ることとなり、口底両面部のみが口底形成となつて口底形成部の口底の形成を防止できない。しかも、加線ローラ両面の口底を個別に口底させるため口底が口底に必要となるうえ、口底の低いヒータを少なくとも2本位用しなければならぬ。

本発明は、口底のようを長手に口底、加線ローラ両面の一口底はバイメタルを位置させ、前述した加線ローラ両面の口底口底は加線ローラの中央部に位置した口底粒子で行なわれ、しかも前述した定形口底は口底バイメタルの口底の位置を口底した各口底部で口底し得る加線ローラ定形口底

は加線ローラ1両面の定形降下線口底の上端と下端で形成され、この2位口底粒子4の各口底部は、図示を省略するけれども、逆像転写の動作図に口底される口底形成図に対する口底信号とされる。

第3図は、前述2位口底粒子4の拡大図面図であり、加線ローラ1両面の口底が定形降下線図内にあるとき2位口底粒子4の口底を示す。この2位口底粒子4は、例えばガラスのように、口底口底を形成する口底形成のケーシング4。バイメタル片Xを口底、このバイメタル片Xを口底して一対の固定部片Y、Zを口底する。バイメタル片Xの先端部は、加線ローラ1両面の口底が定形降下線以下のと固定部片Yに形成され、また加線ローラ1両面の口底が定形降下線を上昇したと固定部片Zに形成される。これらのバイメタル片X、固定部片Y、Zは前述した動作図、口底形成図に口底的に接続され、バイメタル片Xが、第3図の状口、即ち固定部片Y、Zのいずれとも接触したとき動作図に、例えば「CO

「Y」表示を行なわせ、またパイメタル盤片Xが
固定盤片Y、Zのいずれかと接触したとき□告
示部は、例えば「WAIT」、「足音アンダー」
、「オフセット」等の表示を行なわせる。また、
図12 2 位□検出端子4の□告信号は、前述した表
示のほか訂正プロセスの開始制御に用いる場合も
ある。

本発明は以上のように構成されているから、常時時は勿論のこと、受信局や早期受信時の短波、近視短波時に限らず、何らかの原因で加減ローラ１口口の位置が定位置で正確な位置を逸脱したとき、２位口の抽出子４から行各信号が誘せられ、定位置アンダーやオフセット等を検出できる。しかも、逸脱したように位置のずれが甚しい加減ローラ１の長手方向一辺即ちあるいは他に２位口抽出子４を位置させたので、常に良好な定位置を留め得る。また、２位口抽出子４には従来の位置子に用いられる口口を四口を必要とせず、２位口抽出子４は位置に市販されているので、低価格のなる定位置検出を提供できる。

なお、図示は省略するけれども、加硫ローラに、例えば鉄、ステンレス等の腐蝕のない材料を用いた場合、加硫ローラの両端部における腐蝕の深さ量は70℃程度になるので、本発明は、より有用な口缶手取として利用できる。

油圧、本装置は従来の加圧ローラ装置の油圧回路を改良せずに、加圧ローラの一側に位置されるパイプタルの一端で加圧ローラ装置の電磁許容圧を感知できるので、電磁アンダーヤオフセット等の電圧不良が防止できる。

4. 四面の陶器を説明

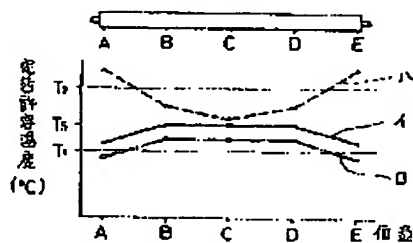
第1圖は従来の加算ロータ装置の最手万肉の凸度分箱圖、第2圖は本發明の加算ロータ電磁装置の加算ロータ廻りの仮略圖、第3圖は2位位出字子の拡大断面圖、第4圖は加算ロータ定角装置廻りの仮略圖である。

1…加島口→、2…庄野口→、4…2位位
の出子。

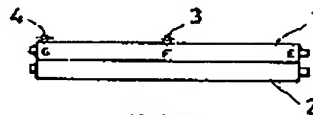
铸 造 出 口 人 小西六写真工业株式会社

代理人 井田士 太 田 兄 弘

第 1 圖



第2圖



3

